

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 23 年 4 月 21 日 (2011.4.21)

【公開番号】特開 2011-49566 (P2011-49566A)

【公開日】平成 23 年 3 月 10 日 (2011.3.10)

【年通号数】公開・登録公報 2011-010

【出願番号】特願 2010-198954 (P2010-198954)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

G 0 1 D 21/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/302 1 0 1 C

H 0 1 L 21/302 1 0 3

G 0 1 D 21/00 G

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 1 月 26 日 (2011.1.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被処理基板が載置される載置部を備えた処理装置の当該載置部に載置されるセンサ基板であって、

前記載置部に載置される被処理基板と略同形同大に形成され、

処理状態の情報を検出する検出素子と、この検出素子が検出した情報を処理する情報処理素子と、を有することを特徴とするセンサ基板。

【請求項 2】

前記処理装置は、プラズマ処理装置である

ことを特徴とする請求項 1 に記載のセンサ基板。

【請求項 3】

前記プラズマ処理装置は、プラズマエッチング処理装置である

ことを特徴とする請求項 2 に記載のセンサ基板。

【請求項 4】

前記被処理基板は、半導体ウエハまたは LCD 用ガラス基板である

ことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載のセンサ基板。

【請求項 5】

前記情報処理素子は、前記検出素子が検出した情報を記憶する記憶素子を有する

ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載のセンサ基板。

【請求項 6】

前記情報処理素子は、前記検出素子が検出した情報を無線でリアルタイムで真空処理装置に送信する送信素子を有する

ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載のセンサ基板。

【請求項 7】

更に 1 以上の微小穴を備えると共に、

検出素子は、微小穴内に設けられている

ことを特徴とする請求項 5 または 6 に記載のセンサ基板。

【請求項 8】

前記検出素子は、パワー密度、 $V_{dc}$ 、 $V_{dc}$ 、赤外線強度、紫外線強度、可視領域光強度、温度、分子量、イオンカレント、加速度、歪み、変位及び音のいずれかを検出する素子からなる

ことを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれかに記載のセンサ基板。

【請求項 9】

被処理基板が載置される載置部と、

前記載置部に載置される被処理基板に対して処理を施す処理機構と、

前記処理機構を制御する制御装置と、

を備え、

前記制御装置は、前記載置部に載置される被処理基板と略同形同大のセンサ基板からの情報に基づいて前記処理機構を制御するようになっている

ことを特徴とする基板処理装置。

【請求項 10】

前記処理は、プラズマ処理である

ことを特徴とする請求項 9 に記載の基板処理装置。

【請求項 11】

前記プラズマ処理は、プラズマエッチング処理である

ことを特徴とする請求項 10 に記載の基板処理装置。

【請求項 12】

前記被処理基板は、半導体ウエハまたは LCD 用ガラス基板である

ことを特徴とする請求項 9 乃至 11 のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項 13】

前記センサ基板は、処理状態の情報を検出する検出素子と、この検出素子が検出した情報を無線でリアルタイムで制御装置に送信する送信素子と、を有し、

前記制御装置は、センサ基板の送信素子からの情報を無線でリアルタイムで受信するようになっている

ことを特徴とする請求項 9 乃至 12 のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項 14】

前記検出素子は、パワー密度、 $V_{dc}$ 、 $V_{dc}$ 、赤外線強度、紫外線強度、可視領域光強度、温度、分子量、イオンカレント、加速度、歪み、変位及び音のいずれかを検出する素子からなる

ことを特徴とする請求項 9 乃至 13 のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項 15】

基板処理装置の搬送機構により搬送可能なセンサ基板であって、

被処理基板と略同形同大であり、

上面にて開口する微小孔を有し、

前記微小孔の開口を塞がないように且つ前記微小孔から突出しないように前記微小孔内に配置された検出素子を有する

ことを特徴とするセンサ基板。

【請求項 16】

前記被処理基板は、半導体ウエハまたは LCD 用ガラス基板である

ことを特徴とする請求項 15 に記載のセンサ基板。

【請求項 17】

前記検出素子が検出した情報を記憶する記憶素子を有する

ことを特徴とする請求項 15 または 16 に記載のセンサ基板。

【請求項 18】

前記検出素子が検出した情報を無線でリアルタイムで制御機構に送信する送信素子を有する

ことを特徴とする請求項 1 5 乃至 1 7 のいずれかに記載のセンサ基板。